【19】中華民國　　【12】專利公報　（U）

【11】證書號數：M688323
【45】公告日： 中華民國 115 (2026) 年 10 月 01 日
【51】Int. Cl.：　*B65D53/02　(2006.01)*　*B65D5/64　(2006.01)*
B65D85/30　(2006.01)

新型　　全 8 頁

【54】名　　稱：　易清潔的密封單元
【21】申請案號：　115207189　　【22】申請日： 中華民國 115 (2026) 年 07 月 29 日
【72】新型創作人：洪碧原 (TW) HUNG, PI-YUAN
【71】申 請 人：　艾眾股份有限公司　　IGROUP CO., LTD.
高雄市鼓山區中華一路 350 號 3 樓之 1
【74】代 理 人：　楊祺雄；吳俊彥

【57】申請專利範圍

1. 一種易清潔的密封單元，適用於封閉一個容器的一個開口，且搭配一個抵推件使用，該易清潔的密封單元包含：
一個基座，可分離地結合於該容器，且包括一個安裝槽，及至少一個連通外界與該安裝槽的通孔，該至少一個通孔具有一個面向該安裝槽的第一孔口，及一個面向外界的第二孔口，該第二孔口可供該抵推件伸入；及
一個氣密墊圈，塞裝在該安裝槽且完全遮擋該至少一個通孔的該第一孔口，當該基座用以結合於該容器時，該氣密墊圈氣密迫抵在該容器與該基座間，當該基座未結合於該容器時，該氣密墊圈可被經由該第二孔口伸入的該抵推件抵推而脫離該安裝槽。
2. 如請求項 1 所述的易清潔的密封單元，其中，該基座包括數個相間隔的該通孔。
3. 如請求項 1 所述的易清潔的密封單元，其中，該至少一個通孔呈圓形、橢圓形或多邊形。
4. 如請求項 1 所述的易清潔的密封單元，其中，該基座的材質為塑膠、玻璃、陶瓷或金屬。
5. 如請求項 1 所述的易清潔的密封單元，其中，該基座包括一個基壁部，及自該基壁部朝該容器延伸且內外間隔的一個第一環壁部與一個第二環壁部，該基壁部、該第一環壁部與該第二環壁部相配合界定出該安裝槽。
6. 如請求項 5 所述的易清潔的密封單元，其中，該基壁部開設有該至少一個通孔。
7. 如請求項 5 所述的易清潔的密封單元，該容器包括一個底壁，及一個自該底壁朝上延伸且界定出該開口的圍繞壁，該圍繞壁具有一個第一結合結構，其中，該第一環壁部具有一個第二結合結構，該第二結合結構用以與該第一結合結構相結合，進而使該基座與該氣密墊圈用以蓋封定位在該容器上。
8. 如請求項 5 所述的易清潔的密封單元，該容器包括一個底壁，及一個自該底壁朝上延伸且界定出該開口的圍繞壁，該圍繞壁具有內外相反的一個內側面與一個外側面，及一個設置在該外側面的第一結合結構，其中，該基座還包括數個自該基壁部朝外延伸且相間隔的耳部，每一個該耳部可相對該基壁部上下擺動，且具有一個第二結合結構，每一個該第二結合結構可與該第一結合結構結合，進而使該基座與該氣密墊圈用以蓋封定位在該容器上。

圖式簡單說明

本新型的其他的特徵及功效，將於參照圖式的實施方式中清楚地呈現，其中：

圖 1 是一個立體分解圖，說明本新型易清潔的密封單元的一第一實施例，且搭配一個容器使用的情形；

圖 2 是一個不完整的剖視圖，說明該第一實施例；

圖 3 是一個示意圖，說明該第一實施例的一個氣密墊圈被一個抵推件抵推以脫離一個安裝槽的情形 ；

圖 4 是一個不完整的剖視圖，說明該第一實施例的該通孔的另一實施態樣；

圖 5 是一個不完整的剖視圖，說明該第一實施例的該通孔的又一實施態樣；

圖 6 是一個立體圖，說明本新型易清潔的密封單元的一第二實施例，且搭配一個容器使用的情形；

圖 7 是一個立體圖，說明本新型易清潔的密封單元的一第三實施例，且搭配一個容器使用的情形；

圖 8 是一個立體圖，說明本新型易清潔的密封單元的一第四實施例，且搭配一個容器使用的情形；及

圖 9 是一個俯視圖，說明本新型易清潔的密封單元的一第五實施例。

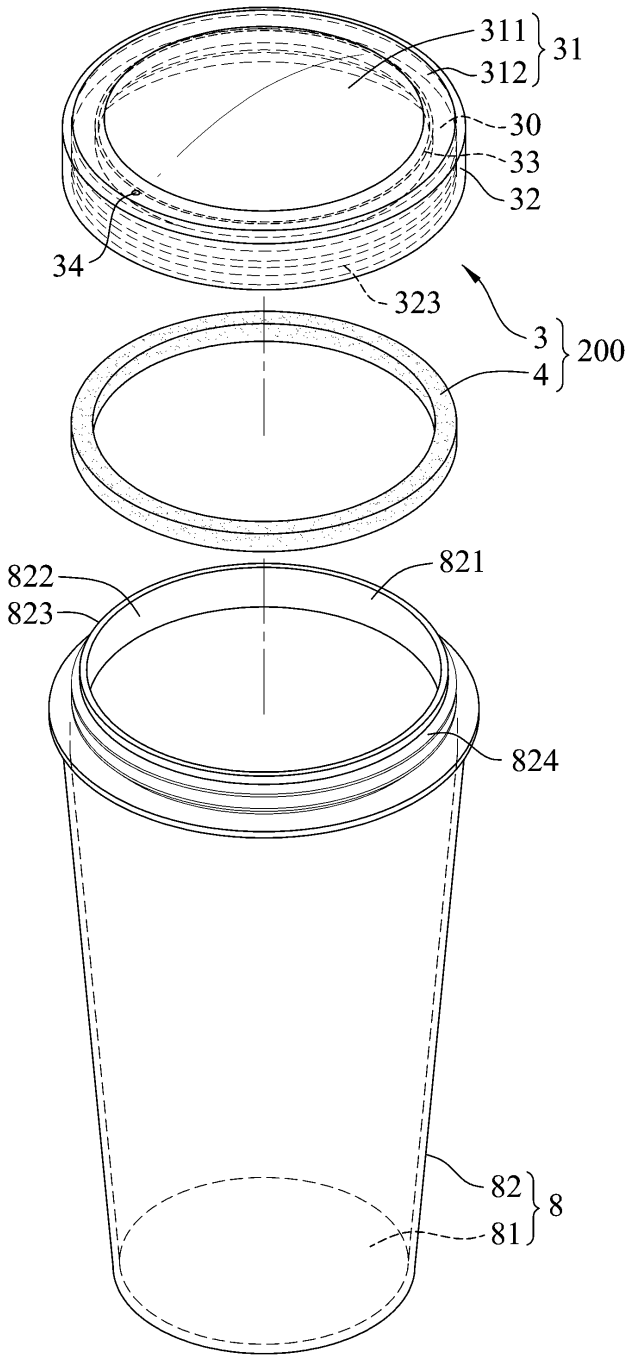


圖1

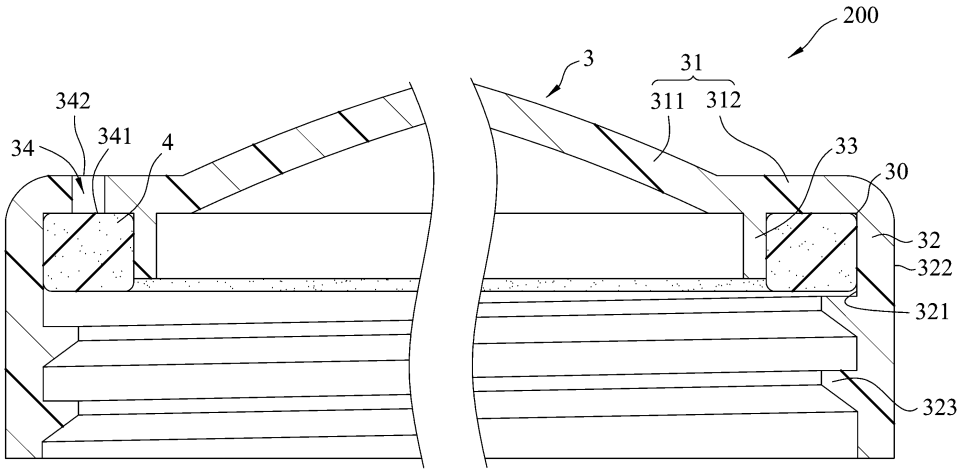

200
3
31
311
312
342
341
34
4
33
30
32
322
321
323

圖2

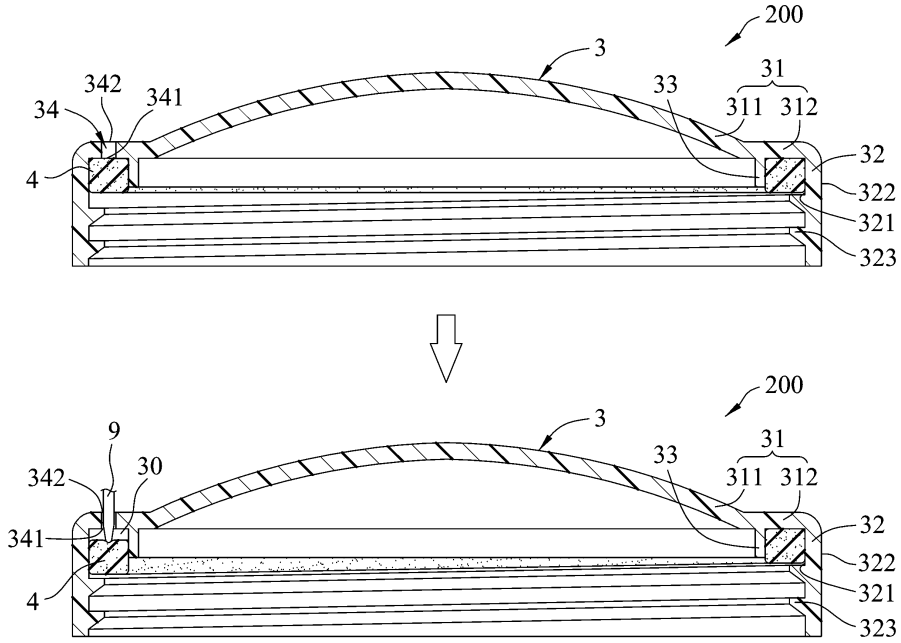

200
3
31
311
312
33
342
341
34
4
32
322
321
323
9
30

圖3

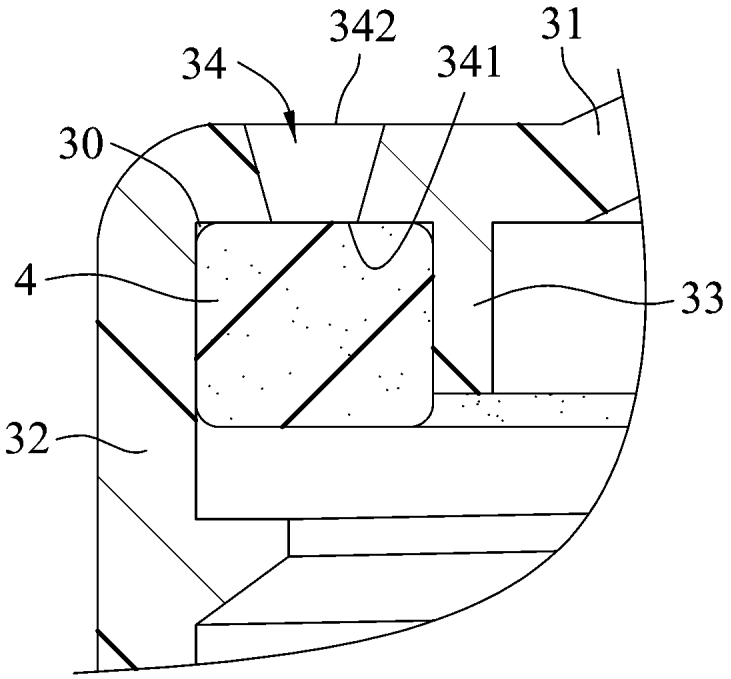


圖4

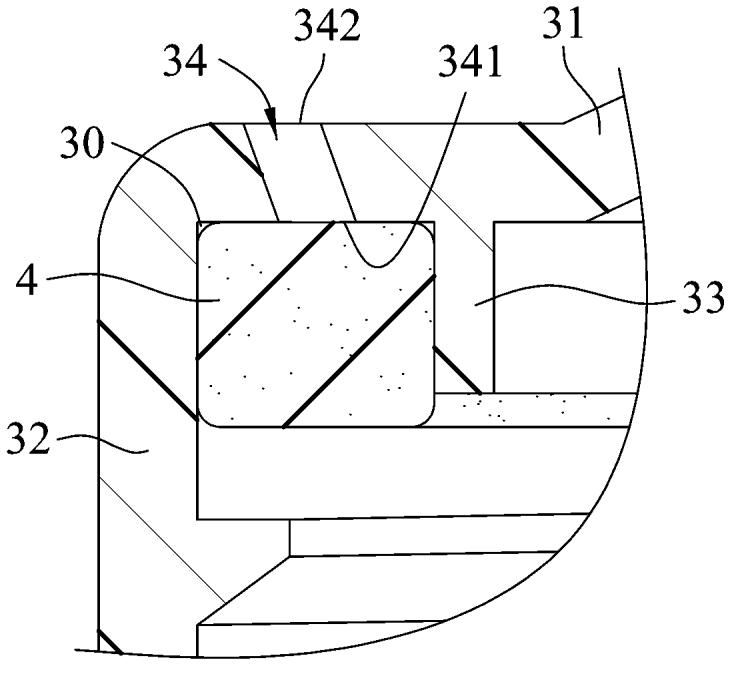


圖5

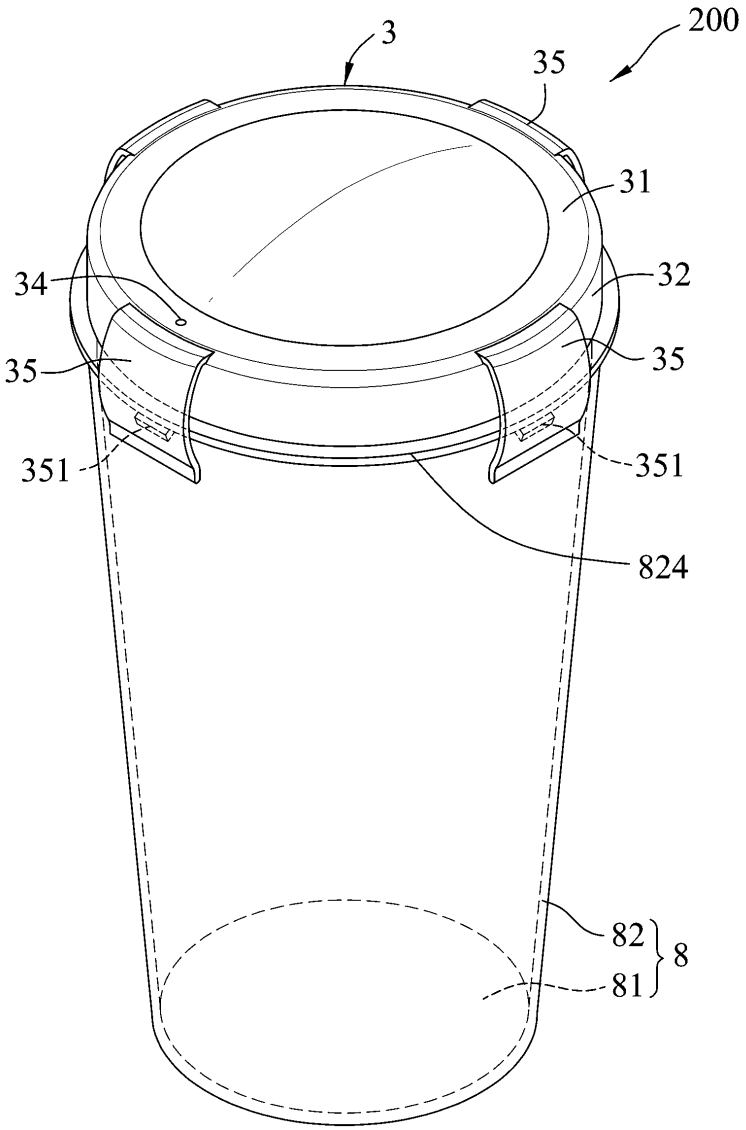


圖6

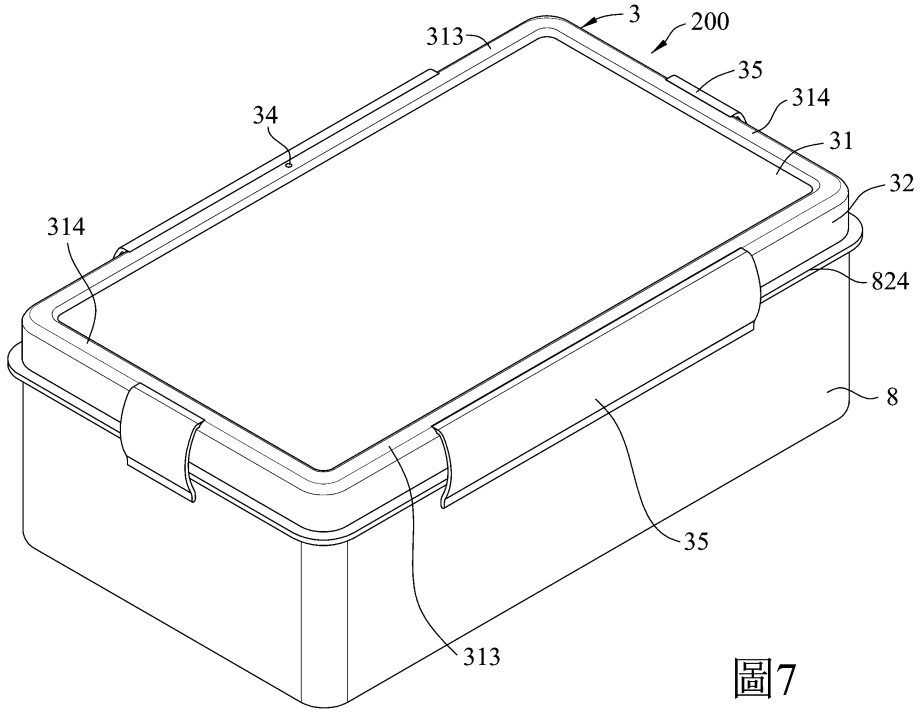

3
200
313
35
314
34
31
32
314
824
8
35
313

圖7

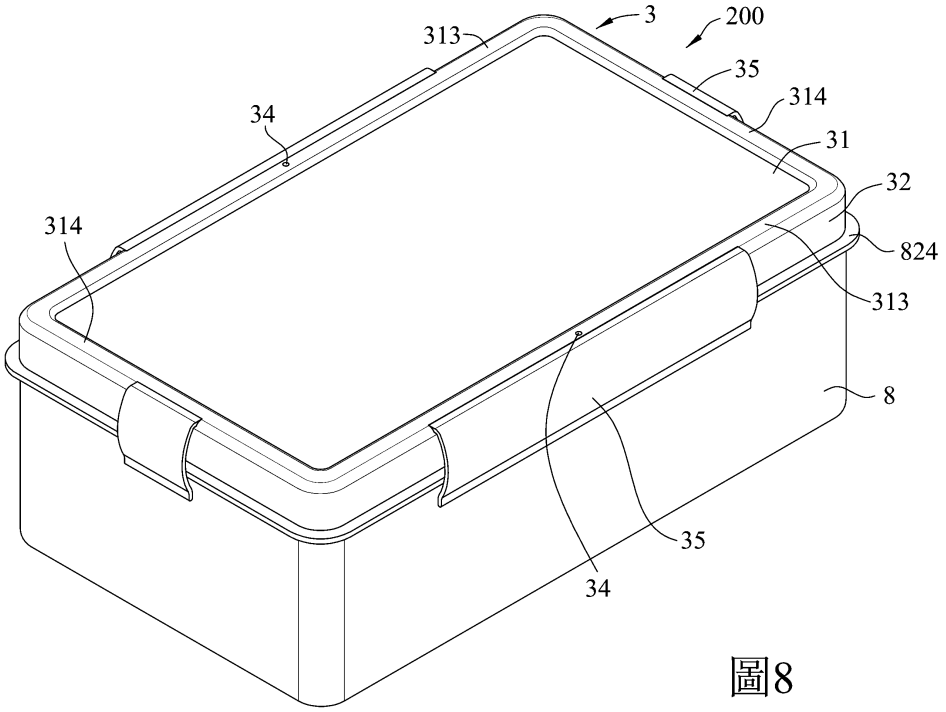

3
200
313
35
314
34
31
32
314
824
313
8
35
34

圖8

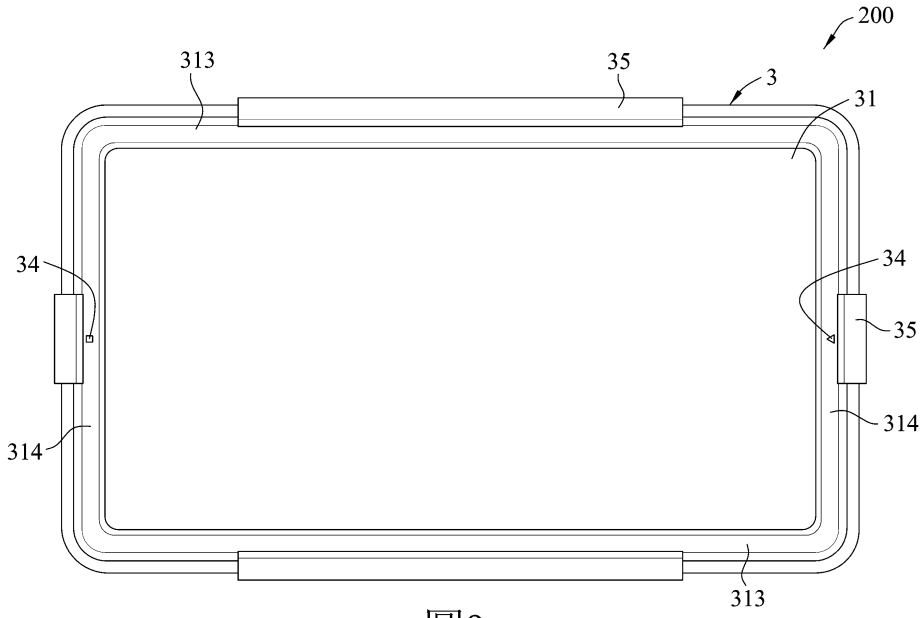


圖9